微波光子技术相控阵雷达天线现场校准系统

张业斌,盛永鑫,田晓光

(中国电子科技集团公司第38研究所,安徽合肥230088)

摘 要:研究了基于微波光子技术的相控阵雷达天线现场校准技术。介绍了微波光子技术进行相控 阵天线现场校准的基本原理,通过利用架设在相控阵天线阵面上的光学探针中的电光晶体的泡克尔 斯效应,使得自探针反射的光学信号携带有天线单元的近场辐射信息,在将其进行光电转换后采用外 差相干检测的方法来获得信号中所携带的天线单元的幅相信息,便可实现对天线阵面天线单元辐射 场信息的快速检测,实验验证系统的电场幅度和相位测量精度可以分别达到 0.3 dB 和 2°,同时该方 法对被测天线单元具有侵入性低、抗干扰能力强、体积小等优点,满足相控阵天线现场校准的实际需 要,具有很强的工程实用价值。

关键词:现场校准; 相控阵雷达天线; 光学探针; 微波光子 中图分类号:O441.5 文献标志码:A DOI: 10.3788/IRLA201746.0717005

In-situ calibration system of phased array radar antenna based on microwave photonic technology

Zhang Yebin, Sheng Yongxin, Tian Xiaoguang

(The 38th Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation, Hefei 230088, China)

Abstract: The in-situ calibration technology of phased array radar antenna has been researched. The principle of phased array antenna in-situ calibration based on the microwave photonic technology was introduced. By taking advantage of Pockels effect of the electro-optical crystal in the optical probes erected on the phased array antenna, the optical signal reflected from the probe was modulated by the measured electromagnetic field. Then the amplitude and phase information of the measured phased array antenna units can be obtained through photoelectric conversion and coherent detection of the optical signal. Experimental results demonstrate that the measurement amplitude and phase accuracy of radiation electromagnetic field respectively reach $0.3 \, dB$ and 2° . And this calibration method has the advantages of low aggressiveness, strong anti-jamming ability, small volume, etc. which can meet the practical demands of phased array antenna calibration and have very strong engineering practical value.

Key words: in-situ calibration; phased array radar antenna; optical probe; microwave photonic

收稿日期:2016-11-07; 修订日期:2016-12-13

基金项目:国防科工局技术基础科研项目(JSJC2013210C042);"十二五"民用航天科工技[2013]669号

作者简介:张业斌(1988-),男,工程师,博士,主要从事微波光子学、光纤传感方面的研究。Email:wzhangyebin@163.com

0 引 言

相控阵雷达¹¹⁻⁷¹以拥有相控阵天线而得名,其摆 脱了传统雷达机械伺服控制系统机械惯性大、精度 差、速度慢等问题,在国土防空、导弹防御系统及舰 载、机载和星载火控、预警系统等军事领域,乃至在 射电天文、卫星通信、气象水文、空中交通管制、地球 勘探和生物医学等国民经济诸部门的广泛应用,日 益受世人的关注和重视。但随着雷达的功能越来越 强大,天线阵元的数量也成倍地增加,其中许多器件 的制造和组装都有差异,常常使各通道呈现出相当 大的幅相误差,从而引起相控阵天线增益的下降、副 瓣的升高甚至波束倾斜。因此在现代相控阵雷达中, 如何能快速准确地确定天线单元的幅相误差,并能 诊断出单元的故障,是保证相控阵雷达性能的重要 环节,具有重要的意义。

目前国内已经建立了相控阵雷达系统的检测及 校准方法,大致分为内校准和外校准两种。内校准是 在雷达系统内部利用附加设备实现雷达性能的监 控,通常做法是在系统内部设置开关矩阵、行波馈电 网络(BITE 耦合系统)等设备形成雷达系统内闭环, 在系统内部对雷达信道中的每个通道幅度和相位进 行检查和修正。内校准实施起来较为方便,为一般小 型相控阵雷达所采用。但内校准技术也存在相当大 的限制,如:(1) 天线阵元数量较多时,由于每个通道 需要配备一组闭环校准系统,设备量非常庞大,成本 很高;(2) 在机载或者星载等领域, 对载荷有严格限 制,而内校准系统会带来额外的载荷量;(3)内校准 只对闭环系统以内的部分进行校准,但对于闭环外 的部分如天线以及天线阵元间的互耦影响等无法校 准。因此对相控阵雷达天线校准需要用到外校准技 术。一般相控阵雷达天线现场外校准方法大致分为 远场校准和近场校准两种方式,远场校准时,需要特 定的测试环境(远距离测试场),并在几个预定角度 上测出天线辐射场幅相信息,再计算获得天线口径 场的幅相分布。这种方法受限于测试场地要求,并且 测试过程中容易受到环境散射及多路径效应的影 响,往往具有较大的误差;在近场测量中,通常使用 的近场接收天线有偶极子、开口波导、喇叭天线等接 收天线放在被测天线阵的近场区域,对被测天线进 行校准,然而这些接收天线由于其均为金属结构从 而会为辐射场测量带来限制^[8]。因此十分需要一种 更为精确的现场近场校准技术可对相控阵雷达天线 进行现场校准。

基于微波光子技术的相控阵雷达天线 现场校准原理

基于微波光子技术[9-12]的相控阵雷达天线现场 校准技术是一种适合近场天线阵发射校准的光学电 磁场探测技术。与传统的基于金属天线的近场测量 不同的是, 通过利用了光学晶体在电磁场环境中的 光学属性的改变来探测被测天线的近场幅度和相位 信息,把电磁场信息转换成光学信息并最终通过光 电转换和信号处理技术来获取被测电场的幅相信 息,该技术具有对被测场的干扰小、空间分辨力高、 不受外界环境的电磁干扰、工作带宽大等诸多优 势。在参考文献[13]中笔者提出了一种基于光子技 术的相控阵天线校准方法,该方法可实现对天线阵 面幅度和相移较高精度的精确校准,但是其系统较 复杂,同时电信号的杂谱较多,导致测量校准的动态 范围有限。文中提出一种结构更加紧凑的基于微波 光子技术的相控阵雷达天线现场发射校准系统,图1 所示为该现场校准方法的系统组成原理图,其主要 包括光学探针阵列、信号处理系统两大部分。其中光



图 1 基于微波光子技术的相控阵天线现场校准系统组成原理图 Fig.1 Schematic diagram of in-situ calibration system of phased array radar antenna based on microwave photonic technology

学探针阵列是用于对被测天线单元的辐射场进行传 感,将被测电场信息加载在激光信号上;信号处理系 统用于将经光学探针阵列反射回来的光学信号进行 解调、放大和信号处理,以获得被测天线单元的电场 辐射信息。

光学探针采用基于电光效应的场测量技术,电 光晶体在外电场的作用下其折射率特性发生改变, 进而改变传输光的偏振态,通过检偏器件将传输光 偏振态的变化转变为光强的变化,图2所示为光学 探针的基本组成示意图。其主要由准直透镜、起偏 器、λ/8 波片、电光晶体以及高反射介质片组成,通过 将这些光学元件集成在小的玻璃细管中,便可对天 线单元的辐射场进行高分辨率的电场测量。



图 2 光学探针光路原理图 Fig.2 Schematic diagram of light path of optical probe

其工作原理为当入射光经过起偏器 P₁后的琼 斯矩阵表示为[E₀,0],则沿图 2 中的路径依次经过光 学元件并经过反射原路返回后的光束的琼斯矩阵可 表示为:

$$\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cos \frac{\pi}{8} \begin{bmatrix} 1 - i\tan \frac{\pi}{8} \cos 2\theta & -i\tan \frac{\pi}{8} \sin 2\theta \\ -i\tan \frac{\pi}{8} \sin 2\theta & 1 + i\tan \frac{\pi}{8} \cos 2\theta \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 - i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' & -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' \\ -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' & 1 + i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 - i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' & -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' \\ -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' & 1 + i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 - i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' & -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' \\ -i\tan \frac{\delta}{2} \sin 2\theta' & 1 + i\tan \frac{\delta}{2} \cos 2\theta' \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 - i\tan \frac{\pi}{8} \cos 2\theta & -i\tan \frac{\pi}{8} \sin 2\theta \\ -i\tan \frac{\pi}{8} \sin 2\theta & 1 + i\tan \frac{\pi}{8} \cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_0 \\ 0 \end{bmatrix} (1)$$

式中: θ 为 λ /8 波片快轴与偏振通光轴夹角; θ 为晶体感应快轴与偏振通光轴夹角; δ 为电光晶体两个

感应主轴上的相位差。当无电场作用时,电光晶体为 单轴晶体则 δ=0,则上式可表示为:

第46卷

从公式(2)可以看出,当 θ =45°时, $I \propto \frac{1}{2} |E_0|^2 = \frac{1}{4} I_0$ (其中 I_0 为入射光强),对于电光调制来说,该位置 也恰为调制的线性工作区,因此当取偏振通光方向 与波片快慢轴夹角为45°时,返回光的琼斯矩阵可 以写为:

$$\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cos \frac{\pi}{8} \begin{bmatrix} 1 & -i\tan\frac{\pi}{8} \\ -i\tan\frac{\pi}{8} & 1 \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \delta \begin{bmatrix} 1-i\tan \delta \cos 2\theta' & -i\tan \delta \sin 2\theta' \\ -i\tan \delta \sin 2\theta' & 1+i\tan \delta \cos 2\theta' \end{bmatrix} \cdot \\ \cos \frac{\pi}{8} \begin{bmatrix} 1 & -i\tan\frac{\pi}{8} \\ -i\tan\frac{\pi}{8} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_0 \\ 0 \end{bmatrix} = \\ E_0 \begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{4}\cos\delta - \sin\frac{\pi}{4}\sin\delta\sin 2\theta' - i\sin\delta\cos 2\theta' \\ 0 \end{bmatrix} (3)$$

公式(3)进行了近似计算(δ 远小于 1),略去 δ 高 阶小值后可得 $I=\frac{1}{4}$ (1-4 δ sin2 θ ') I_0 ,因此当 θ '=45° 时,可以获得最高的调制效率,最终可得:

$$I = \frac{1}{4} (1 - 4\delta) I_0 \approx \left(\frac{1}{4} - \delta\right) I_0 \tag{4}$$

从公式(13)可以看出,当小信号近似时,因电光 效应产生的相位差与入射光强成线性关系。目前最 常用的电光晶体为铌酸锂晶体,其优点是其在可见 光及红外波段的透过性好,且易于光学加工,也是目 前商用电光调制器中电光材料的常用选择。铌酸锂 晶体作为单轴晶体,沿其光轴Z轴传输时,传输光不 发生双折射,当在外电场作用下,由于泡克尔斯效应 产生新的折射率感应主轴,传输光发生双折射。经过 对比分析,实验中选择Z轴通光的横向电光效应设 计,这种情况下,通过晶体后的相位差可以表示为:

$$\delta = \frac{2\pi\Delta nL}{\lambda} = \frac{2\pi L}{\lambda} n_0^3 \gamma_{22} E \tag{5}$$

式中:n₀为晶体中 O 光折射率;λ 为传输光波长;γ₂ 为电光系数;E 为外电场场强;L 为晶体长度,因此 传输光强为:

$$I = \frac{1}{2} (1 - \sin 2\delta) I_0 \approx \left(\frac{1}{2} - \delta\right) I_0 = \left(\frac{1}{2} - \frac{2\pi L}{\lambda} n_0^3 \gamma_{22} E\right) \alpha I_{\text{Laser}}(6)$$

式中: α 为激光器输出光在光链路中的累计插损。公 式(6)表明经过光学探针反射回来的光学信号中携 带有完整的被测电场的信息,并且输出光强信号与 被测电场 E 成线性关系。因此光电探测器输出的电 压与电光晶体所处的电场场强成线性关系,通过在 信号处理系统中对反射回来的光信号进行信号处理 便可以获得被测电场的准确信息。

信号处理系统提供了光路选择、光电变换、外差 检测以及信号处理等功能,其组成如图1中所示。为 了减小测量装置的复杂度和体积,同时实现大天线 阵面的快速检测,系统选用了多路探针的光学探针 阵列共用一条微波信号处理链路的设计,信号处理 系统中的光开关用于切换选择触发光学探针,通过 一次架设可以完成对多个天线单元的测量校准,可 大大节省测量时间和工作成本。从光学探针反射回 来的激光信号经过光电探测器后被转换为微波信 号,为了同时获得被测电场的幅度和相位信息,实验 中采用外差检测的方法利用锁相放大模块对该微波 信号进行解调。

由于选用的锁相放大模块对输入信号的频率要 求 200 MHz 以下,而雷达射频信号的频率较高,因 此在现场校准时,需要另外一个参考信号作为本振 信号对雷达射频信号进行下变频,该参考信号源和 雷达信号源的输出射频信号频率应该相近,频率间 隔低于 200 MHz,用于将光电转换的射频信号进行 下变频。在信号处理系统中,经过光电转换后射频信 号进入到混频器 2 的射频端进行下变频,其中频信 号输出接入锁相放大模块的信号输入端。参考信号 源输出的射频信号经过功分器一分为二,一路输出 连接到混频器 2 的本振端,另一路连接到混频器 1 的本振端,雷达信号源的输出射频信号经过定向耦 合器分为两部分,一部分用于天线阵面的激励;另一 部分作为混频器1的射频输入,其下变频产生的中频 信号用作锁相放大模块的参考信号输入。在锁相放大 模块中,混频器2输出的中频信号和混频器1提供的 中频参考信号进行比相和放大,最后得到被测天线单 元电磁场的相对幅度和相对相位信息数据,从而实现 对天线阵面各个天线单元的近场测量校准。

2 基于光电技术的相控阵雷达天线现场 校准实验验证

为了验证基于光电技术的相控阵雷达天线现场 校准系统的性能,设计了 X 波段 16 路光学探针阵列 的校准系统,并对其进行了实验验证。图 3 所示为搭 建的系统实物图,图 3(a)为制作的单根光学探针,其 主要工作部分为前端光学元件集成处,其后细长的 玻璃细管用于保护光纤尾纤以及便于固定架设在天 线阵面,图 3(b)为实验系统装置。测量过程中 16 根 同批次制作的光学探针通过定制的安装支架固定架 设在相控阵天线阵面上,每个探针保持与天线单元 一一对应,同时探针前端与对应天线单元的距离均 保持为 2 mm。





图 3 光学探针(a)和校准系统实物图(b) Fig.3 Photo of optical probe (a) and calibration system (b)

对于相控阵雷达天线来说,天线的辐射方向图 是评价天线最重要的指标。相控阵雷达天线众多天 线阵元之间的辐射场的相对幅度和相位是影响天线 辐射方向图的最重要因素,在实际的相控阵天线测量 中,由于场强绝对值的测量不确定度较高,因此通常 以某一天线单元为的幅相值为基准,进而获得各天线 阵元的幅相的相对基准值的变化,也就是相对幅度和 相位,实验中对这两项参数进行了测试,选取的雷达 信号频率为10 GHz,参考信号频率为 10.031 GHz,通 过控制天线单元的激励信号改变天线单元辐射场的 强度和相位,再通过架设在天线阵面上的 16 路探针 依次获取天线单元的辐射信息与其进行了比较。

图 4 所示为在雷达信号源输出后接可调衰减器 后,通过调节衰减器的衰减值来改变天线单元的激励信号的强度,以实现天线单元辐射电场强度在 1~ 200 V/m 的 23 dB 的范围内变化。其中图 4(a)为通过 实验系统测得的 16 路天线单元的辐射电场的幅值变 化与实际天线单元辐射场的标称变化值对应的曲线 图,图 4(b)为天线单元辐射场在不同的标称值下,所 测得的天线单元的辐射电场的幅度变化值与实际天 线单元辐射场的标称变化值的偏差曲线图。 其中图 5(a)为通过实验系统测得的 16 路天线单元的 辐射电场的相移与实际天线单元辐射场的标称相移 对应的曲线图,图 5(b)为天线单元辐射场在不同的标 称变化值下,所测得的天线单元的辐射电场的相移与 实际天线单元辐射场的相移的偏差曲线图。

从上述的实验结果可以看出,基于微波光子技 术的该天线校准系统的实测值与标称值有很好的线 性关系,同时具有很高的相对幅度和相移校准精度, 从公式(6)中可以看出校准系统的测量误差的主要来 源为激光器输出激光的功率和相位的抖动以及微波 信号处理中的射频放大链路增益的波动。因此在测 量过程中选择输出功率稳定和低的相对强度噪声的 激光器以及增益平坦的射频放大器并且通过优化散 热设计保证激光器和放大器的工作温度可以降低这 些因素引起的系统测量误差。实验中测得系统的幅 度测量误差小于 0.3 dB,相移测量误差小于 2.0°。相 比于之前在参考文献[13]中提出的校准系统,该校 准系统除了结构更加简洁紧凑之外,其测量误差更 小,测量结果具有更好的线性度。





图 5 所示为在雷达信号源输出后接移相器后, 通过调节改变天线单元的激励信号的相位,以实现 天线单元辐射场电场的相位发生 20°~180°的改变。



图 5 天线单元相移测试结果

Fig.5 Measured phase shift results of antenna units

3 结 论

文中针对相控阵雷达天线现场校准的实际需

求,开展了基于微波光子技术的相控阵雷达天线现场 发射校准系统的研究,利用光学电磁场探针对被测场 的干扰小、抗电磁干扰、测量精度高、空间分辨力高、 体积小等诸多优点,采用 16 路光学探针经过光开关 切换依次工作的方法方式,通过单次架设测量实现了 对相控阵天线 16 个天线单元的近场幅度和相移的精 确测量,实验验证了校准系统的辐射电场的幅度和相 移测量误差分别小于 0.3 dB 和 2°,远远优于传统微波 校准方法。通过该方法对相控阵雷达天线单元的辐射 近场进行实验或雷达服役现场的快速精确的测量校 准,可以大大节省相控阵雷达天线校准所需的物力和 人力成本,同时对提升雷达系统的指向精度和扫描精 度等指标均具有重要的指导意义。

参考文献:

- Brookner E. Phased-array radars [J]. Scientific American, 1985, 252: 94–102.
- [2] Mailloux P. Phase Array Antenna [M]. London: Artech House, 2005.
- [3] He Xiaoxian, Wang Xiangru, Li Man, et al. Research review on mid-infrared liquid crystal optical phased array [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2016, 45(8): 0830003. (in Chinese) 贺晓娴, 汪相如, 李曼, 等. 液晶中波红外光学相控阵关键

技术研究进展[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(8): 0830003.

[4] Liu Guixiong, Tang Wenming, Tan Daji. Focusing time delay of ultrasonic phased array based on multistage half-band filter [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2014, 22(6): 1571-1576. (in Chinese) 刘桂雄, 唐文明, 谭大基. 基于多级半带滤波器的超生相

控阵聚焦延时[J]. 光学 精密工程, 2014, 22(6): 1571-1576.

[5] Wu Chao, Liu Chunbo, Han Xiang'e. Design of waveguide optical phased array ladar receiving system [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2016, 45(10): 1030003. (in Chinese) 吴超, 刘春波, 韩香娥. 光波导相控阵激光雷达接收系统 设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1030003.

- [6] Yang Zuoyun, Wang Dayong, Wang Yunxin, et al. Measure-ment method for the half-wave voltage of phase modulator based on the principal of laser phased array [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(3): 906–910. (in Chinese) 杨作运,王大勇,王云新,等. 基于激光相控阵原理的相位 调制器半波电压测量方法 [J]. 红外与激光工程, 2015, 44 (3): 906–910.
- [7] Han Qi, Xu Lixin, Wang Ting, et al. Coupled feed phased array antenna integrated with MEMS phase shifter [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2015, 23(10z): 272–278. (in Chinese) 韩琦,徐立新,王婷,等. 集成 MEMS 移相器缝隙耦合和 相控阵天线[J]. 光学 精密工程, 2015, 23(10z): 272–278.
- [8] Li Hong, Xue Bing, Yang Yingke. The technology of measuring and testing phased array antennas [J]. *China Measurement Technology*, 2003(9): 10–11. (in Chinese) 李宏, 薛冰, 杨英科. 相控阵天线的测试技术 [J]. 中国测 试技术, 2003(9): 10–11.
- [9] Paolo Ghelfi, Francesco Laghezza, Filippo Scotti, et al. A fully photonics-based coherent radar system [J]. *Nature*, 2014, 507: 341–345.
- Paolo Ghelfi, Francesco Laghezza, Filippo Scotti, et al. Photonic generation and independent steering of multiple RF signals for software defined radars [J]. *Opt Exp*, 2013, 21: 22905–22910.
- [11] Capmany J, Novak D. Microwave photonics combines two worlds[J]. *Nature Photo*, 2007, 1: 319–330.
- [12] Li Jing, Ning Tigang, Pei Li, et al. Study on a radio over fibre link with improved receiver sensitivity based on polarization modulation[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2016, 45(6): 0617004. (in Chinese)
 李晶, 宁提纲, 裴丽, 等. 基于偏振调制的最优接收灵敏度的 ROF 链路研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(6): 0617004.
- [13] Sheng Yongxin, Tian Xiaoguang. On-site calibration of phased array antennas based on optical technology [J]. *Metrology & Measurement Technology*, 2015, 35(6): 20-23. (in Chinese) 盛永鑫,田晓光. 基于光子技术的相控阵雷达天线现场校 准技术[J]. 计测技术, 2015, 35(6): 20-23.